#### 한경대학교 전기전자제어공학과 유동상 교수



# 전기회로설계믳실험 ||





- 실험 목적
  - RC 직·병렬 회로의 교류특성 이해 및 임피던스 계산
- 강의 내용
  - RC 직렬회로
  - RC 병렬회로
- 오늘의 실험
  - Multisim을 이용한 시뮬레이션
  - 브레드보드에 회로 구성을 통한 실험 및 계측



• RC 직렬회로에서의 정현파 응답



저항과 커패시터가 직렬로 연결된 경우 전원 전압과 전원 전류
 사이의 위상각은 0에서 90도 사이에 있으며, 저항값과 리액턴스
 값에 따라 변함



• RC 직렬회로에서의 임피던스



$$\mathbf{Z} = R - jX_C$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}, \quad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$
$$\mathbf{Z} = \sqrt{R^2 + X_C^2} \angle -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$



• RC 직렬회로에서의 전압과 전류의 위상 관계



- 저항 전압은 전류와 동상 (in phase)을 이루고, 커패시터 전압은 전류보다 위상이 90도 지연되므로, 저항 전압과 커패시터 전압은 90도의 위상차가 있음
- 전원 전압은 저항 전압과 커패시터 전압의 합 벡터로 구성되며
   따라서 전원 전압은 저항 전압보다 θ만큼 위상이 지연됨
- 위상각 θ는 임피던스에서 위상각과 동일

- 에 따라 리액턴스가 작아지고 따라서 임피던스도 작아짐 - 또한 리액턴스가 작아짐에 따라 위상각도 작아짐
- 용량성 리액턴스 *X<sub>C</sub>*은 주파수에 반비례하므로, 주파수가 증가함에 따라 리액턴스가 작아지고 따라서 임피던스도 작아짐



• 주파수 변화에 따른 리액턴스 및 임피던스 변화





• RC 병렬회로에서의 정현파 응답



저항과 커패시터가 병렬로 연결된 경우 전원 전압과 전원 전류
 사이의 위상각은 0에서 90도 사이에 있으며, 저항값과 리액턴스
 값에 따라 변함



• RC 병렬회로에서의 임피던스



$$\mathbf{Z} = \frac{R(-jX_C)}{R - jX_C} = \frac{RX_C \angle -90^{\circ}}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$
$$= \frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \angle \left(-90^{\circ} + \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)\right) = \frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} \angle \left(-\tan^{-1}\left(\frac{R}{X_C}\right)\right)$$



• RC 병렬회로에서의 전압과 전류의 위상 관계



$$\mathbf{I}_{total} = I_R + jI_C = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{I_C}{I_R}\right), \ I_{total} = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}, \ \theta = \tan^{-1} \left(\frac{I_C}{I_R}\right)$$

- 저항 전류는 전원전압과 동상 (in phase)을 이루고, 커패시터 전류 는 전원전압보다 위상이 90도 앞서게 되므로, 저항 전류와 커패 시터 전류는 90도의 위상차가 있음
- 전원 전류는 저항 전류와 커패시터 전류의 합 벡터로 구성되며 따라서 전원 전류는 저항 전류보다 θ만큼 위상이 앞섬
- 이때 위상각 θ는 임피던스에서 위상각과 크기가 동일하며 부호 는 반대

- 교류전원 모델
  - AC Power를 이용하여 5Vrms와 5kHz로 설정
  - 전류 실효값 측정을 위해 멀티미터를 직렬 연결한 후 교류 전류 측정 모드로 설정
  - 전압 실효값 측정을 위해서는 교류 전압 측정 모드로 설정



- 시뮬레이션 수행
  - 측정값 전류값과 전압값을 이용하여 저항의 저항값, 커패시터의 리액턴스, 직렬회로의 전체 임피던스 크기와 위상 계산 (교재에 나온 수식은 틀린 수식이므로 무시)
    - 저항  $R = \frac{V_{R_{-}rms}}{I_{rms}}$

• 리액턴스 
$$X_C = \frac{V_{C_rms}}{I_{rms}} = \frac{1}{2\pi fC}$$

• 임피던스크기 
$$Z = \frac{V_1}{I_{ms}} = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$
 (V1 : 전원전압 실효값)

• 임피던스위상 
$$\theta = -\tan^{-1}\frac{X_C}{R} = -\tan^{-1}\frac{V_{C_{-}ms}}{V_{R_{-}ms}} = -\tan^{-1}\frac{1}{2\pi fCR}$$

• 임피던스  $\mathbf{Z} = R - jX_C = R - j\frac{1}{\omega C} = Z \angle \theta$ 



• 시뮬레이션 결과 기록

C [µF]	주파수 [kHz]	I <sub>rms</sub> [mA]	$V_{R\_rms}$ [V]	$V_{C\_rms}$ [V]	R [Ω]	X <sub>C</sub> [Ω]	Ζ [Ω]	θ [degree]
0.01	5							
	8							
	10							
0.02	5							
	8							
	10							
0.03	5							
	8							
	10							

- 오실로스코프를 이용한 파형 관찰
  - CH1은 전원전압 파형 측정
  - CH2는 커패시터 전압 파형 측정
  - CH3는 Current Probe를 이용하여 전류 파형 측정
  - 오실로스코프의 Math Menu 버튼을 누른 후 Operation 버튼을 눌 러 "-" 선택하고 CH1-CH2으로 설정 (전원 전압에서 커패시터 전 압을 빼므로 저항 전압을 연산에 의해 파형 측정 가능





VOLTS/D

Current Probe Properties		×
Ratio of voltage to current:	1	V/mA
Accept	Cancel	
		.::

- 전원 전압은 전원 전류보다 위상 뒤져 있음
- 커패시터 전압은 전원 전압보다 위상이 뒤져 있음
- 저항 전압은 전원 전압보다 위상이 앞서 있음
- 저항 전압은 전원 전류와 위상이 같음
- 커패시터 전압은 전원 전류 (= 커패시터 전류 =저항 전류) 보다 위상이 90도 (1/4 주기) 뒤 져 있음





- 오실로스코프를 이용한 위상 관찰
- RC 직렬 회로 시뮬레이션

- 교류전원 모델
  - AC Power를 이용하여 5Vrms와 1kHz로 설정
  - 전류 실효값 측정을 위해 멀티미터를 직렬 연결한 후 교류 전류



- 시뮬레이션 수행
  - 측정값 전류값과 전압값을 이용하여 저항의 저항값, 커패시터의 리액턴스, 직렬회로의 전체 임피던스 크기와 위상 계산 (교재에 나온 수식은 틀린 수식이므로 무시)
    - 저항  $R = \frac{V_1}{I_{R_rms}}$  (V1 : 전원전압 실효값)

• 리액턴스 
$$X_C = \frac{V_1}{I_{C_rms}} = \frac{1}{2\pi fC}$$

• 임피던스크기 
$$Z = \frac{V_1}{I_{ms}} = \frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

• 임피던스위상 
$$\theta = -\tan^{-1}\frac{R}{X_{C}} = -\tan^{-1}\frac{I_{C_{-}ms}}{I_{R_{-}ms}} = -\tan^{-1}2\pi fCR$$

• 임피던스  $\mathbf{Z} = Z \angle \theta = Z \cos \theta + jZ \sin \theta$ 



• 시뮬레이션 결과 기록

C [μF]	주파수 [kHz]	I <sub>rms</sub> [mA]	I <sub>R_rms</sub> [mA]	I <sub>C_rms</sub> [mA]	Re(Z) [Ω]	Im(Z) [Ω]	Ζ [Ω]	θ [degree]
0.1	1							
	2							
	3							
0.2	1							
	2							
	3							
0.3	1							
	2							
	3							

- 오실로스코프를 이용한 파형 관찰
  - CH1은 전원전압 파형 측정
  - CH2는 Current Probe를 이용하여 전원 전류 파형 측정
  - CH3는 Current Probe를 이용하여 저항 전류 파형 측정
  - CH4는 Current Probe를 이용하여 커패시터 전류 파형 측정



• 오실로스코프를 이용한 위상 관찰



- 노란색 파형 (CH1) : 전원 전압 v<sub>1</sub>
- 하늘색 파형 (CH2) : 전원 전류 i
- 분홍색 파형 (CH3) : 저항 전류 *i*<sub>R</sub>
- 초록색 파형 (CH4) : 커패시터 전류 *i<sub>C</sub>*

 $I_{C}$ 

 $V_1$ 

 $I_{R}$ 

- 전원 전압(=커패시터 전압=저항 전압)은 커 패시터 전류 보다 위상이 90도 (1/4 주기) 뒤 져 있음
- 커패시터 전류는 전원 전류보다 위상이 앞서 있음
- 저항 전류는 전원 전류보다 위상이 뒤져 있음
- 저항 전류는 전원 전압과 위상이 같음
- 전원 전류는 전원 전압보다 위상이 앞서 있음



- 1. 함수발생기 설정
  - 멀티미터의 ACV 버튼을 누르고, 다시 Shift 버튼을 누른 후 AC+Hz 버튼을 누른 다음에 함수발생기와 연결하여 멀티미터에 5kHz와 5V<sub>rms</sub>가 표시되도록 함수발생기를 조정
- 2. 실험 회로 구성
  - 함수발생기, 저항 및 커패시터를 그림과 같이 직렬 연결



- 3. 전압 및 전류의 실효값 측정
  - 멀티미터의 ACA 버튼을 누른 후 프로브를 저항과 직렬 연결하여 저항에 흐르는 전류의 실효값을 측정 →  $I_{R_rms}$
  - 멀티미터의 ACV 버튼을 누른 후 프로브를 커패시터와 저항 양단 에 걸리는 전압의 실효값을 각각 측정  $\rightarrow V_{C_{rms}}, V_{R_{rms}}$



4. 임피던스 및 위상각 계산



- 임피던스위상  $\theta = -\tan^{-1}\frac{X_C}{R} = -\tan^{-1}\frac{V_{C_mms}}{V_{R_mms}} = -\tan^{-1}\frac{1}{2\pi fCR}$
- 5. 실험 결과 기록

C [μF]	주파수 [kHz]	I <sub>rms</sub> [mA]	$V_{R\_rms}$ [V]	$V_{C\_rms}$ [V]	R [Ω]	X <sub>C</sub> [Ω]	Ζ [Ω]	θ [degree]
0.01	5							
	10							
0.02	5							
	10							

• 다른 주파수 및 커패시터에 대해 Step 1부터 Step 5까지 반복 수행



- 1. 함수발생기 설정
  - 멀티미터의 ACV 버튼을 누르고, 다시 Shift 버튼을 누른 후 AC+Hz 버튼을 누른 다음에 함수발생기와 연결하여 멀티미터에 1kHz와 5V<sub>ms</sub>가 표시되도록 함수발생기를 조정
- 2. 실험 회로 구성
  - 함수발생기, 저항 및 커패시터를 그림과 같이 병렬 연결



- 3. 전압 및 전류의 실효값 측정
  - 멀티미터의 ACA 버튼을 누른 후 프로브를 전원과 직렬 연결하여 전원 전류의 실효값을 측정 → *I<sub>rms</sub>*
  - 같은 방법으로 저항과 커패시터에 흐르는 전류의 실효값을 측정  $\rightarrow I_{R_rms}, I_{C_rms}$



- 4. 임피던스 및 위상각 계산
  - · 저항
      $R = \frac{V_1}{I_{R_mms}}$  (V1:전원전압실효값)

     · 리액턴스
      $X_C = \frac{V_1}{I_{C_mms}} = \frac{1}{2\pi fC}$  

     · 임피던스 크기
      $Z = \frac{V_1}{I_{ms}} = \frac{RX_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$  

     · 임피던스 위상
      $\theta = -\tan^{-1} \frac{I_{C_mms}}{I_{R_mms}} = -\tan^{-1} \frac{R}{X_C} = -\tan^{-1} 2\pi fCR$
- 5. 실험 결과 기록

C [μF]	주파수 [kHz]	I <sub>rms</sub> [mA]	I <sub>R_rms</sub> [mA]	I <sub>C_rms</sub> [mA]	R [Ω]	X <sub>C</sub> [Ω]	Ζ [Ω]	θ [degree]
0.1	1							
	3							
0.2	1							
	3							

• 다른 주파수 및 커패시터에 대해 Step 1부터 Step 5까지 반복 수행